

CIF 匀胶机



CIF 匀胶机转速稳定、启动迅速，旋涂均匀，操作简单，结构紧凑实用，为实验室提供了理想的解决方案。广泛应用于微电子、半导体、新能源、化工材料、生物材料、光学，硅片、载玻片，晶片，基片，ITO 导电玻璃等工艺制版表面涂覆等。

产品特点

- ◆ 采用闭环控制伺服电机，数字式增速信号反馈，速匀准确，寿命长，保证匀胶均匀。
- ◆ 5寸全彩触摸屏，智能程序化可编程操控显示，标配 10 个匀胶梯度阶段（速度和时间梯度设置），可选配 10 个可编程程序，每个程序下可设置 10 个匀胶梯度阶段，最多 100 个阶段。
- ◆ 内置水平校准装置，最大限度的保证旋涂均匀，可对大小不同规格的基片进行旋涂。
- ◆ **多重安全保护**
电磁安全开关，盖子打开卡盘停止，保证安全；
盖子自锁功能，防止飞片盖子弹开伤人；
双重安全上盖，聚四氟镶嵌钢化玻璃，避免单一玻璃或者亚克力上盖飞片伤人，最大限度保证实验人员安全。
- ◆ 一机两用，根据不同样品可选真空吸盘和非真空卡盘两种旋涂模式。
- ◆ 不锈钢喷塑涂层旋涂壳体，PTFE 旋涂腔体，聚丙烯（NPP-H）旋涂托盘，PTFE 镶嵌钢化玻璃上盖，耐酸碱防腐蚀，保证仪器在苛刻条件下仍能正常运行。
- ◆ 适用硅片、玻璃、石英、金属、GaAs, GaN, InP 等多种材料。



技术参数

型号	转速 (转/分)	转速稳定度	匀胶时间	旋涂基片尺寸 mm	外型尺寸 (LxWxH) mm
SC1	50-10000	±1%	0-2000S	圆片Φ5-Φ100,方片最大 100x100	310x260x250